

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【公表番号】特表2009-523325(P2009-523325A)

【公表日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【年通号数】公開・登録公報2009-024

【出願番号】特願2008-550404(P2008-550404)

【国際特許分類】

H 01 L 21/673 (2006.01)

B 65 D 85/86 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/68 T

B 65 D 85/38 R

【手続補正書】

【提出日】平成22年1月6日(2010.1.6)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

密閉でき且つ少なくとも1つの基板を収容するように適応された包団体と、

上記包団体へ通じていて、基板キャリヤが閉じられている間に上記包団体へのガスの流れを許容するように適応された第1のポートと、\_\_\_\_\_

を備え、

上記包団体の内側の圧力が上記包団体の外側の圧力より高い、基板キャリヤ。

【請求項2】

上記第1のポートは、ガス源が上記第1のポートに対して密閉されるように適応された第1のシールを含む、請求項1に記載の基板キャリヤ。

【請求項3】

上記第1のポートは、第2のシールを含む、請求項2に記載の基板キャリヤ。

【請求項4】

上記第2のシールは、上記第1のシールを取り囲むように配設される、請求項6に記載の基板キャリヤ。

【請求項5】

上記第1のポートは、上記基板キャリヤのドアに配設され、

真空源に対して密閉され且つ上記基板キャリヤのドアに真空力を加えられるように適応された第2のシールを含む、

請求項2に記載の基板キャリヤ。

【請求項6】

上記ドアに加えられる上記真空力は、上記第1のポートを通して上記基板キャリヤ内へガスが流されることにより生成される力に対抗するように適応される、請求項5に記載の基板キャリヤ。

【請求項7】

第2のポートを更に含み、上記第2のポートは、ガスを上記基板キャリヤから流出できるように適応され、上記第2のポートは、排気チャネルを上記第2のポートに対して密閉できるように適応された第1のシールを含む、請求項1に記載の基板キャリヤ。

**【請求項 8】**

上記第2のポートは、更に、上記第2のポートの上記第1のシールの周りに配設された第2のシールを含み、上記第2のシールは、真空源に対して密閉され、且つ上記基板キャリヤの上記第2のポートの上記第1のシールの周りの領域へ真空力を加えられるようにして、上記第1のポートを通して上記基板キャリヤ内へガスを流すことにより生成される力に対抗するように適応される、請求項7に記載の基板キャリヤ。

**【請求項 9】**

ロードポートにおいて、

基板キャリヤを開放するため上記基板キャリヤのドアに結合するように適応されたプレートを備え、

上記プレートは、上記プレートの第1の側部において上記基板キャリヤのドアにおける第1のポートに結合し且つ上記プレートの第2の側部においてガス源に結合するように適応された第1の開口を含み、

上記ロードポートは、上記プレートにおける上記第1の開口を通して上記基板キャリヤへのガスの流れを許容するように適応される、

ロードポート。

**【請求項 10】**

上記プレートは、更に、第2の開口を含み、

上記第2の開口は、上記プレートの上記第2の側部において真空源に結合するように適応され、上記第2の開口は、上記第1の開口の周りに配設された空間が上記プレートの上記第1の側部において排気されるように配設され、上記空間は、上記第1の開口を上記第1のポートに対して密閉する第1のシール及び上記第1のシールの周りに配設され上記第2の開口を上記第1のポートに対して密閉する第2のシールによって画成される、

請求項9に記載のロードポート。

**【請求項 11】**

排気チャネルを更に含み、

上記プレートは、更に、上記プレートの上記第2の側部において上記排気チャネルに結合され且つ上記プレートの上記第1の側部において上記基板キャリヤにおける第2のポートに結合される第3の開口を含む、

請求項10に記載のロードポート。

**【請求項 12】**

基板キャリヤの外側の圧力よりも高い圧力を上記基板キャリヤの内側に生成するように上記基板キャリヤへガスを流すステップと、

ドア開口を通して上記基板キャリヤからガスを流出させるため上記基板キャリヤのドアを開放するステップと、

を備えた方法。

**【請求項 13】**

上記ガスを流すステップは、密閉された基板キャリヤへ上記ガスを流す段階を含む、請求項12に記載の方法。

**【請求項 14】**

上記ガスを流すステップは、

上記ガスを上記基板キャリヤの上記ドアに配設された第1のポートを通して上記基板キャリヤへ流す段階と、

上記ガスが上記基板キャリヤへ流れることによって生成される力に対抗するように上記ドアに真空力を加える段階と、

を含む、請求項12に記載の方法。

**【請求項 15】**

上記基板キャリヤの上記ドアに配設された第2のポートを通して上記基板キャリヤから空気を排出することを更に含む、請求項14に記載の方法。